## 6-2 負負量効果とMOS 反転層内キャリヤのエネルギ分散: 新しい固体発振素子の可能性

東芝総合研究所

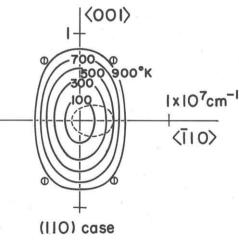
前田南

一方、金属-酸化物-半導体(MOS)電界効果トランジスタにおける反転層内キャリヤの運動は、強いケート電界の下では その方向では量子によれることが知られたがつこの立場で近似的に求めた 2次元的エネルギ分散は Siの ウチヤンネル内キャリヤの 易動度異方性も定性的によく説明でする。から 量子に理論によると、量子化まれた キャリヤの状態には、バルク・キャリヤの、ゲート電界方向の波数の大きい状態が大きく混合(ていることが示される。

多勾配をもつ三角型のものを、幅w,高t無限大の 1次元井产型で置きかえると、今向題にする場合には

En(kx, kx) = Ez.n+{E(kx, kx, Kn)-Ez.n},
Ezn=Min.E(kx, ky; Kn)=E(0,0, Kn), Kn=N匹, n=0,1,…
で、以下では最低サブバンド n=0 のみも取扱う。
KnとFgとは、Eznを、質量 m茎の粧子の電界 Fig
下の固有エネルギ あよび 1 次元井戸型 ポテンシャル下の
固有エネルギと等しいと置いて マナズーつ"ナる:

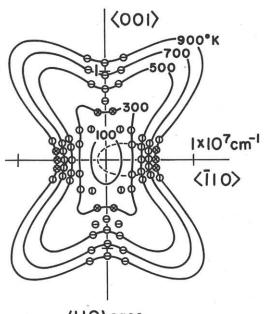
 $Ezn=\hbar^2 K_{7/2}m_{z}^2=\chi_{1}^{(heFq)^{3/3}}(2m_{z}^2)^{3/3}$ ,  $\chi_{n}=$  数の零点。
(ii) 価電子帯では  $E(\vec{R})$  は 3 %73 引の マトリクス であるか、  $Ezn < m_{z}^{2/3}$ , かっ 上言し近似では 各正孔 独立に なるので、 息い エネルギでない ア長り light hole 状態の 混入の影響 は小さいと 奏えて、  $E(\vec{R})$  とこては



 $Si, F_G \sim 4. \times 10^5 \text{ v/cm}$ 

Reavy hole の分散のみを拝用する。  $E(\vec{k})$  は k-p 攝動の固有方程式  $^{9)}$ を解いて応めた。使用した  $^{10}$ ラナータ は Stickler  $^{10}$ の 逆質量パラナータと  $^{2}$  wendling  $^{5}$   $^{11}$ 0 spin orbit splitting である。

結果は、Figか大きいと Siでは予期(ていたように、それの大きくなるために、く1107 swelling 効果はと生に等で表れず曲線(等を線)が楕円的になり、正質量領域が増す。これは典型的な3つのケースを国示する。 Siの Fig~4×105√cmの場合は、近似の条件を細く検討するとよく活はれているが、上述の理由で質質量に関えては否定的である。 Siの Fig~6.×104√cmの場合は近似条件に厚恕でいか、負質量効果については魅力的であり、Geの Fig~1.×105√cmの場合は魅力的であり、你の近似条件もよく満まれている。 図で等を線の数字はわがいたの適合なら、エネルギ(oK)を示し、①○⊗の記号は負質量を分える領域を示している:



(IIO) case

 $Si, F_G \sim 6.\times 10^4 \text{ v/cm}$ 

①: mys<0, mxx>0 ; Θ: mxx<0, mys>0 ; ⊗: mxx<0, mys<0 ; XII<T10>, 5II<001>。 結果も総括すると、3之えの場合と違い図の面積はそのか 狀態数を表わすから、負質量領域は五かっている。 Ge の方が mtが小小まく <110> swelling 効果も小さいため、電界が高くとも正質量領域が小さく、近似度もよい。 素子構成としては (110) ウェーハ面にゲート酸化層を設け、<T10>方向に dc "streaming" 電極 <001>方向に負性抗電極、または <001>方向に負性抗電極、または <001>方向に付け、例では、<001>方向になる "streaming" 電極、<100>方向になる "streaming" 極を設け、それと といたを25小る。 また同じケート配置で、くT10> もくはくの1> 方向に dc "streaming" 極を設け、それと 同じ極から ac 出力を得る "non-parabolicity"型も可能であるう。 反転層での散化に対する知見か

少ないので、まtheaming、効果の評価が難しいか、 国では 分布の広かりの一つの目安として、く下の方向へを学的カルン エネルギ(Ge:430°K、Si:750°K)相当、重直方向へ77°K相当の領は成か、点線で示してある。 これから員易動度の 実現性を誘論できる。 細かい素子構成 おまび他の 界面方向の設計につけても 討論したい。 以上では 生に P型層につけて述べたか、 位導帯で期待すれる "non-pavabolicity"型につけても、バルケでは易よネルギ 散送へ加速するのに大電力が少零であるとけう欠点は、 やはり MOS補造の利用によって解決できると思われる。

Ge,  $F_G \sim 1.0 \times 10^5 \text{ v/cm}$ 

<sup>(</sup>IIO) case

D.H. Krömer: Proc.IRE 47(59)397.

2) W.E. Pinson etal: Phys.Rev.136(64)A1449,
A.C. Baynham etal: P. Lit. Conf. S.C. Phys. Revis. p49, 8) 前田: '郑明学之: 4回译和第5. p.65.
3) T. Kurosawa: P. Lit. Conf. S.C. Phys. Kydio p424, 9) B.O. Kane: J. Phys. Chew. Solids.1 (56) 82.
H.F. Budd: ibid p.420,

4) T. Kurosawa + H. Maeda: in preparation, 1) S. Sweeding etal: Phys. Rev. Letters 4 (60) 73.

5) D. Colman etal: Jappl Phys. 29 (68) 173. 12) H. Miyazawa etal: Phys. Rev. Letters 4 (60) 73.